

## JIS Q 9001:2015 (ISO9001:2015)

第 13 版
<b>登録事業所</b>
キヤノンアネルバ株式会社 本社 神奈川県川崎市麻生区栗木 2 丁目 5 番 1 号  1.半導体製造装置、ストレージデバイス製造装置、パネルデバイス製造装置、研究開発用成膜装置、真空コンポーネント製品、ガス分析装置、表面分析装置の設計、開発、製造、販売、改造管理及び保守サービス管理 2.真空関連設備の設計、開発、製造、販売、改造管理及び保守サービス管理
キヤノンアネルバ株式会社 富士事業所 山梨県南都留郡鳴沢村 8532-28  1.半導体製造装置、ストレージデバイス製造装置、パネルデバイス製造装置、研究開発用成膜装置、真空コンポーネント製品、ガス分析装置、表面分析装置の設計、開発、製造及び改造管理 2.真空関連設備の設計、開発、製造及び改造管理
キヤノンアネルバ株式会社 西日本営業/西日本サービス 大阪府吹田市南金田 2-14-35 中央社ビル  1.半導体製造装置、ストレージデバイス製造装置、パネルデバイス製造装置、研究開発用成膜装置、真空コンポーネント製品、ガス分析装置、表面分析装置の販売、改造管理及び保守サービス管理 2.真空関連設備の販売、改造管理及び保守サービス管理
キヤノンアネルバ株式会社 九州営業/九州サービス 熊本県熊本市中央区帯山 3-3-10 キヤノン MJ 熊本ビル  1.半導体製造装置、ストレージデバイス製造装置、パネルデバイス製造装置、研究開発用成膜装置、真空コンポーネント製品、ガス分析装置、表面分析装置の販売、改造管理及び保守サービス管理 2.真空関連設備の販売、改造管理及び保守サービス管理



本書面は、認証組織の事業の目的のみに使用される真正な認証文書です。当該認証文書の印刷版は複製として取り扱う事が可能です。本書面は、SGS ジャパン株式会社によって、次のページより参照することができる「認証サービスの一般条件」に従って発行されたものです。SGS ホームページ「サービスの一般条件」「認証サービスの一般条件」に規定されている責任の制限と補償に関する条項および管轄に関する条項等に従います。本書面は著作権により保護されており、本書面の内容または体裁について、許可なく偽造、変造または改ざんすることは違法です。



## JIS Q 9001:2015 (ISO9001:2015)

<p>キヤノンアネルバ株式会社 東北サービス 宮城県仙台市宮城野区岩切分台 3-3-15</p> <p>1.半導体製造装置、ストレージデバイス製造装置、パネルデバイス製造装置、研究開発用成膜装置、真空コンポーネント製品、ガス分析装置、表面分析装置の改造管理及び保守サービス管理 2.真空関連設備の改造管理及び保守サービス管理</p>
<p>キヤノンアネルバ株式会社 長野サービス 長野県塩尻市大門並木町 1-1</p> <p>1.半導体製造装置、ストレージデバイス製造装置、パネルデバイス製造装置、研究開発用成膜装置、真空コンポーネント製品、ガス分析装置、表面分析装置の改造管理及び保守サービス管理 2.真空関連設備の改造管理及び保守サービス管理</p>
<p>キヤノンアネルバ株式会社 金沢サービス 石川県金沢市西都 1丁目 54</p> <p>1.半導体製造装置、ストレージデバイス製造装置、パネルデバイス製造装置、研究開発用成膜装置、真空コンポーネント製品、ガス分析装置、表面分析装置の改造管理及び保守サービス管理 2.真空関連設備の改造管理及び保守サービス管理</p>
<p>キヤノンアネルバ株式会社 広島サービス 広島県三原市宮浦 6-17-5</p> <p>1.半導体製造装置、ストレージデバイス製造装置、パネルデバイス製造装置、研究開発用成膜装置、真空コンポーネント製品、ガス分析装置、表面分析装置の改造管理及び保守サービス管理 2.真空関連設備の改造管理及び保守サービス管理</p>



本書面は、認証組織の事業の目的のみに使用される真正な認証文書です。当該認証文書の印刷版は複製として取り扱う事が可能です。本書面は、SGS ジャパン株式会社によって、次のページより参照することができる「認証サービスの一般条件」に従って発行されたものです。SGS ホームページ「サービスの一般条件」「認証サービスの一般条件」に規定されている責任の制限と補償に関する条項および管轄に関する条項等に従います。本書面は著作権により保護されており、本書面の内容または体裁について、許可なく偽造、変造または改ざんすることは違法です。



審査登録証 JP09/061592, 付属書

# キヤノンアネルバ株式会社

JIS Q 9001:2015 (ISO9001:2015)

キヤノンアネルバ株式会社  
四国サービス  
徳島県徳島市沖浜 2-37

- 1.半導体製造装置、ストレージデバイス製造装置、パネルデバイス製造装置、研究開発用成膜装置、真空コンポーネント製品、ガス分析装置、表面分析装置の改造管理及び保守サービス管理
- 2.真空関連設備の改造管理及び保守サービス管理



本書面は、認証組織の事業の目的のみに使用される真正な認証文書です。当該認証文書の印刷版は複製として取り扱う事が可能です。本書面は、SGS ジャパン株式会社によって、次のページより参照することができる「認証サービスの一般条件」に従って発行されたものです。SGS ホームページ「サービスの一般条件」「認証サービスの一般条件」に規定されている責任の制限と補償に関する条項および管轄に関する条項等に従います。本書面は著作権により保護されており、本書面の内容または体裁について、許可なく偽造、変造または改ざんすることは違法です。

